11 of 49 DOCUMENTS

COPYRIGHT: 1987, JPO & Japio

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

62235691

October 15, 1987

FINGERPRINT PATTERN INPUT DEVICE

INVENTOR: IKEHATA SHIGEKI

APPL-NO: 61076672

FILED-DATE: April 4, 1986

ASSIGNEE-AT-ISSUE: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

PUB-TYPE: October 15, 1987 - Un-examined patent application (A)

PUB-COUNTRY: Japan (JP)

IPC-MAIN-CL: G 06K009#20

CORE TERMS: fingertip, photodetectors, prescribed, processor, optical

ENGLISH-ABST:

PURPOSE: To exactly position a fingertip as to both its center position and degree of inclination against the measuring surface of an optical device, by placing plural photodetectors in a prescribed pattern, and detecting a position, an attitude, etc., of the fingertip.

CONSTITUTION: Photodetectors 11a, 11b are fixed onto the upper face of a reflecting surface 6b of a prism 6 being an optical device. Outputs of these photodetectors 11a, 11b are inputted to differential amplifiers 12a, 12b being signal processors, and by these outputs, a position, an attitude, etc. of a fingertip 7 are detected. After the fingertip 7 has been set to a prescribed position, a fingerprint 7a of the fingertip 7 is brought to an image pickup by a television camera 8, and processed by a processor 9.

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭62-235691

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

. . . .

❸公開 昭和62年(1987)10月15日

G 06 K 9/20

6942-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

匈発明の名称 指紋パターン入力装置

②特 願 昭61-76672

20出 願 昭61(1986)4月4日

砂発 明 者 池 端

重樹

尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社応用機

器研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

砂代 理 人 弁理士 田澤 博昭

外2名

明 細 誓

1. 発明の名称

指紋パターン入力装置

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

との発明は、指紋パターン入力装置、特にセキ

ユリテイ機器等の指紋照合装置に適用して、光学ブリズム等の光学装置上に載置した指先の指紋 パターンを読み取つて入力するようにした装置に関するものである。

〔従来の技術〕

次に動作について説明する。処理装置9は例え ばセキュリテイ機器等に接続されて、常に指紋照 合のために待機しており、指紋を確認すべき被検 者の指先 7 の一部が、ブリズム 6 に当接したとき に指紋 7 a をテレビカメラ 8 により撮像する。と の撮像に当つては、まずコリメータ1のランプ3 からピンホール 4 a を介して凸レンズ 5 により平 行光線束L1を照射し、プリズム6の入射面6a から入射させて反射面 6 b により反射させ、この 反射して出射面 6 c から出射した出射光 L 2 を指 紋7aとしてテレビカメラ8により画像化する。 前記平行光線束 L1 は面 6 b で反射する際に、指。 先7の指紋7aのうち山状の線として盛り上つた 陸線部は反射面 6 b に接触し、谷状の線として刻 まれた 部分は反射面 6 bに非接触となつているた めに、指紋 7 a の非接触部分の平行光線東 L 1 は 全反射光となり前配出射光 L 2 として出射面 6 c より出射するが、接触部分の平行光線束L1は非 全反射光となり出射面 6 c からは出射しない。と のようにして指紋7aの前記降線部は例えば暗パ

装置の測定表面に対して中心位置,傾斜度ともに 正確に位置決めされるようにして、指紋パターン の特徴量抽出処理作業の煩雑さ及び困難さを緩和 する指紋パターン入力装置を得ることを目的とす る。

[問題点を解決するための手段]

この発明に係る指紋パターン入力装置は、ブリズム等の光学装置の表面側に複数の受光素子を所定パターンに配置し、この受光素子が検出した光量を電気信号に変換して指先の位置,姿勢等を検知する信号処理装置を設けるようにしたものである。

〔作 用〕

この発明における指紋パターン入力装置は、光学装置の測定表面に収置された指先の中心線や傾斜度を指先の陰影として検出し、この陰影に基いて指先の置かれている位置が特徴量を抽出するのに最適であるか否かが確認され、客観的な基準により指先が位置決めされているか否かを判別する。

〔與施例〕

ターン、谷状部分は明パターンとして画像10化でき、この画像10を処理装置9にて電気信号に変換処理され、その特徴量が抽出されて予め例えばLAM等に入力されている被検者の指紋と比較照合したり、或いは新規にこの指紋を分類記憶させたりして利用することができる。

[発明が解決しようとする問題点]

この発明は上記のような問題点を解消するため になされたもので、指紋を測定すべき指先が光学

次に動作について説明する。上記構成を有する ブリズム 6 の反射面 6 b 上に、第 1 図に示すよう に、指紋 7 a を下側にして指先 7 を矢印のように 戦量する。このとき、第 2 光頭 1 4 が点灯されて 反射面 6 b に設けられた受光案子 1 1 の夫々には 等量の光線が照射されているが、指先了がこの光 線を遮ることにより受光器子11の失々の受光量 に差異が生じ、この差異は指先7の略中心線に対 して対称に配置されている受光素子対 1 1 a の各 受光紫子間の受光量の差として表われるときには、 登動アンプ12aにより検出され、また、受光素 子対11bの各受光素子間の受光量に差があると きは差動アンプ12bがこの差異を検出するので、 第3図に示すように、プリズム6の反射面6bの 中心線C1と指先7の中心線C2とにメレがある 場合には、差動アンプ12a,12bともにとの メレを検知し、被測定者が指先を適宜移動させて 指先7を適正な位置に位置決めすることができる。

なお、上述したものはこの発明の一実施例を示 すのみであり、この発明の目的を逸脱しない限り、 如何なる変形・変更も自由である。例えば、受光 米子11は対11a,11bとして 2 対をプリズ ム反射面 6 b の上面に貼着するものとして説明し たが、この発明はこれに限定されず、不透明材の 受光湯子を無数に反射面 6 b 上面に分散させて改

に、複数の受光索子を配設し、との受光索子の受 差動アンプである。 光滑を信号に変換してその偏りを検出する信号処 理装置により、指先の位置、姿勢等を正確に位置 決めするようにしたので、複雑かつ困難であつた 指紋の特徴量の検出を、指先により遮られる受光 量の差という確実かつ客観的な基準に基いて正確 に行うことができ、指紋の検出及び風合等の処理 を簡易化でき、また精変の高いものが得られる効 果がある。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図はこの発明の一実施例による指紋パター ン入力装置の要部を示す斜視図、第2図は同じく 装置の一部断面正面図、第3図は同じく平面図、 第4図は従来の指紋パターン入力装置の一例を示 す概略構成図である。

図において、1は第1光城(コリメータ)、6 は光学装置(ブリズム)、6bは表面(反射面)、 7は指先、7 aは指紋、8は変換装置(テレビカ メラ)、11は受光素子、11a,11bは受光

け、とれら多数の受光素子を失々対となるように して信号線により信号処理装置に接続して受光量 の偏りを検出して、より精度の高い受光量の検出 を行りよりにしてもよい。但し、指紋7aパメー ンの検出を阻害しないように配置するものとする。

また、信号処理装置12は受光索子対11a, 1 1 b 毎に追動アンプ 1 2 a , 1 2 b を設けるも のとして説明したが、とれにも限定されず、ブリ メム反射面の受光量の偏りを検出し得るものであ れば、他の平衡型増幅器を用いてもよく、また、 より複雑な演算増幅器を設けてより顧密な受光量 の検出を行うようにしてもよい。

なお、上述したものとは逆に、受光米子をブリ メム反射面 6 b 上の中心線 C 1 に対称となるよう 指先了の幅に相当する長さだけ雕聞させて一対の み設けるようにして、構成を簡略化しても適用で きることは勿論である。

〔発明の効果〕

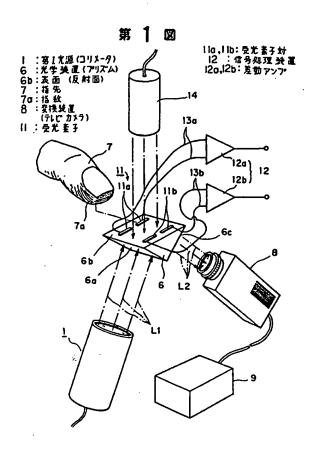
以上のように、との発明によれば指紋パターン

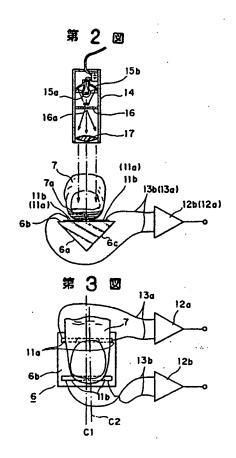
尚、図中同一符号は同一又は相当部分を示す。

停許出額人 三菱筑機株式会社

代坦人 弁理士 (外2名)







第 4 図

